| Inhalt | | Seite | |
|--|---|-------|--|
| Themenkreis I: Grundlagen | | | |
| W. Luhs und HP. Meiser | Neue Strahlungsquellen für die Laserinterferometrie | 3 | |
| F. Hock | Schnelle Messung von Interferenzphasen und Ordnungs- zahlen in der hochauflösenden Laserinterferometrie im Hinblick auf Anwendungen in der Refraktometrie, der Längen-, Winkel- und Schwingungsmessung | 19 | |
| C. P. Wang | Absolute Laser Interferometry Using Doppler Radar Effect with Varying Frequency | 33 | |
| H. Müller | Differenz- und Referenz-Dopplerverfahren zur Längen- und Geschwindigkeitsmessung bewegter Festkörper mit rauhen Oberflächen | 45 | |
| R. Brinkmann | Konzeption und Systematik zur Abnahmeprüfung von Laserinterferometer-Systemen | 61 | |
| Themenkreis II: N | leue Entwicklungen | | |
| A. Lewin | Measurement of Motion and Vibration by Means of a Laser Interferometer Utilising Optical Fibres | 77 | |
| C. Zanoni | Differential Interferometer Arrangements for Distance and Angle Measurements: Principles, Advantages and Applications | 93 | |
| HP. Meiser, W. Luhs und D. Frerking | Neue relative und absolute Laserinterferometer-Refrakto- meter für die Messung der Brechzahl von Luft, Gasen und Flüssigkeiten | 107 | |
| W. Gorski | Prinzip und Anwendung von Laserdilatometern zur Bestimmung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Probekörpern Principle and Application of Laser Dilatometers for the Determination of the Thermal Expansion of Solids | 121 | |
| K. Leonhardt, KH. Rippert und H. Tiziani | Mikro-Profilometrie zur Bestimmung der Topographie und Rauheit technischer Oberflächen mittels Heterodyn- Laserinterferometrie Heterodyn Microprofilometry for Industrial Surface Measurements | 139 | |

Inhalt

| | | Seite |
|------------------------------|---|-------|
| P. Strack | Präzisonsmeßtaster mit Halbleiter-Laserinterferometer Precisionprobe with Integrated Laserinterferometer | 153 |
| Themenkreis III: N | Neue Anwendungen | |
| HH. Paul | Konstruktionsprinzipien zur Darstellung hochgenauer Zwei-Koordinaten-Meßmaschinen Design and Calibration of a Two-Dimensional High Precision Meterology System | 165 |
| W. Baetz und W. Holzapfel | Laserinterferometer-Anordnung für kombinierte Translations- und Kippwinkelmessung | 177 |
| D.M.G. Stevens | The Measurement of Dimension, Form and Surface Finish Using a Single Interferometer Profilometer | 193 |
| F. Kitzsteiner | Interferometrische Messung von Radial-, Axial- und Taumelabweichung an Drehtischen | 203 |
| HH. Schüßler | Probleme und Lösungswege bei der automatischen interferometrischen Abnahmeprüfung von Koordinatenmeßgeräten mit numerischer Korrektur bzw. mit Handbedienung | 221 |